ترسیب الکتروشیمیایی رنیوم از محلول پررنات آمونیوم بر روی تک کریستال سیلیسیوم

حامد عطایی اصفهانی^۱، سید خطیب الاسلام صدرنژاد^۲ پژوهشگاه مواد و انرژی و دانشگاه صنعتی شریف sadrnezh@sharif.edu, ataee@mehr.sharif.edu

چکیدہ

مطالعه مورفولوژی رسوبات الکتریکی اجزاء رنیوم بر روی الکترود تک کریستال سیلیکون از محلول حاوی پررنات انجام شد. شرایط نشست و احیاء الکتریکی پررنات آمونیوم بر روی الکترود سیلیکون و همچنین مورفولوژی اجزاء رسوب کرده توسط تکنیکهای ولتامتری چرخهای، کرونوآمپرمتری و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) بررسی شد. همچنین مکانیزم جوانهزنی رسوب با تکنیک کرونوآمپرمتری مورد بررسی قرار گرفت و انتقال مکانیزم جوانهزنی سه بعدی از حالت لحظه ای به پیشرونده برای ترسیب رنیوم با کاهش پتانسیل پیشنهاد شد.

واژههای کلیدی: رنیوم، رسوب الکتروشیمیایی، ولتامتری چرخهای، کرونو آمپرمتری، تک کریستال سیلیسیوم ، مورفولوژی رسوب

۱- مقدمه

امروزه با پیشرفت تکنولوژی، رنیوم بواسطه دمای ذوب بالا(۳۱۹۰^۵C) و پایداری شیمیایی در دمای بالا کاربردهای وسیعی یافته است. با توجه به اینکه برخی از نمکهای رنیوم ، با وجود دمای ذوب بالای آن قابلیت انحلال خوبی دارند، رسوب الکتروشیمیایی آن میتواند در دمای اتاق تولید شود [۱] .در گذشته به علت مصرف فزاینده رنیوم و ترکیبات آن به عنوان کاتالیزور، مطالعه ترسوب رنیوم از محلول اسیدی پررنات بر روی زیر لایههای مختلف

۱ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه مواد و انرژی

۲ استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه مواد و انرژی

ترسيب الكتروشيميايي رنيوم از... مانند پلاتین، نیکل، کبالت و یا مس موضوع پژوهشهای مهمی بوده است[۲-۴] . همچنین سرعت رشد بالای صنایع الکترونیک و هدایت آن به سمت نانو فناوری کاربردهای گسترده ای را برای لایه های محافظ پایه فلزی بوجود آورده است [۱ و ۲]. علاوه بر کاربردهای فوق امروزه سطوح رنیوم- سیلیسیم در تولید ابزارهای میکرو الکترونیک مانند لایه های مقاومت بالا (high-resistant layers) ، امیترها (emitters) ، موانع (barriers)و پایدار کردن سيليسيم متخلخل ودر وسايل ترموالكتريك كاربرد دارند. رسوب الكتروشيميايي فلز روى نيمه رساناها مناسب ترين روش برای تولید موانع شاتکی (Schottky barriers)، سنسورهای گاز واتصالات اهمیک کیفیت بالا (high) (quality ohmic contacts مي باشد. خواص ويژه سيليسيد رنيوم نيز باعث پيشرفت قابل توجه تكنولوژي رسوب رنيوم بر روى سيليسيوم شده است [۵] . با توجه به اينكه با تغيير پتانسيل اعمالي وتركيب الكتروليت مي توان در مدل رشد و ساختار رسوب تغییر قابل توجهی را ایجاد کرد ، بنابراین بررسی جزئیات مکانیزم جوانه زنی ورشد ضرورى بەنظر مىرسد.

با توجه به معادله فوق واضح است که با کاهش pH و افزایش پتانسیل هیدروژن در محلول، واکنش احیای پررنات به رنیوم بیشتر به سمت تولید رنیوم فلزی میرود، ولی با کاهش زیاد pH شرایط برای پایداری اکسیدهای رنیوم فراهم مي شود [۴]. واكنش كلي احياء ير رنات در محيط خنثي وقليايي نيز طبق واكنش ۲ است: (٢)

 $\operatorname{Re} O_{4}^{-} + 4H_{2}O + 7e^{-} \rightarrow \operatorname{Re} + 8OH^{-}$

همانطور که در واکنشهای بالا مشاهده میشود، احیای یون -ReO مستلزم دریافت هفت الکترون میباشد بنابراین انتخاب نادرست پارامترهای ترسیب منجر به تشکیل ناخالصیهای اکسیدی در رسوب می شود[۱]. تجربه Schrebler وهمكارانش[۵]نشان ميدهد محصول احياي الكتروشيميايي يون ⁻ReO در محلول اسيدي رقيق (pH = 2) و بر روی الکترود تک کریستال سیلیسیوم در پتانسیلهای منفی ترازاحیاء هیدروژن، رنیوم خالص فلزی میباشد.

۲- مواد و روش تحقيق

سلول مورد استفاده، سلول سه جزئي ساخته شده از جنس شيشه پير کس بوده و از الکترودهاي صفحهاي سيليکون و یلاتین به ترتیب به عنوان کاتد و آند استفاده شد. مساحت الکترود کاری در آزمایشها ۱ cm² بود. الکترود Ag/AgCl به عنوان الكترود مرجع استفاده شد و كليه پتانسيلها ي ذكر شده در اين تحقيق نسبت به الكترود مرجع Ag/AgCl مىباشد.

["]همایش ملی مواد نو "

Fluka Chemie محلولهای مورد استفاده به وسیله حل کردن پودر پررنات آمونیوم خالص (ساخت شرکت Fluka Chemie محلولهای مورد استفاده به وسیله حل کردن پودر پررنات آمونیوم خالص (ساخت شرکت pH=۲ مویس) در آب سه بار تقطیر تولید شده و غلظت این محلولها NH4ReO4 می اشد. محلولها در pH=۲ مویس) در آب سه بار تقطیر تولید شده و غلظت این محلولها موریک و هیدروکسید آمونیوم غلیظ صورت گرفت وکلیه آزمایشها در دمای \mathbf{C}^{0} ۲۵ و تحت دمش گاز نیتروژن خالص انجام شد.

برای انجام آزمایشهای الکتروشیمیایی از دستگاه پتانسیواستات – گالوانواستات مدل M۲۷۳A ساخت شرکت EG&G PAR کشور ایالات متحده و دستگاه Autolab Pgstat30 ساخت کشور هلند استفاده شد.

برای آماده سازی الکترود سیلیسیم کریستالهای با جهت <۱۰۰ سیلسیم (با دوپ برن، p-type و با مقاومت الکتریکی $0 \, r$ ۱۰ (۲ میل از استفاده در ۲-پروپانول به مدت ۲ ساعت چربی زدایی شده و سپس به مدت ۱۰ دقیقه در محلولهای بازی و اسیدی $H_2O_2: H_2O_2: H_2O_2: H_2O_2: H_2O_2: H_2O_2$ و NH₃: $H_2O_2: H_2O_2: H_2O_2: H_2O_2: H_2O_2$ (با نسبتهای $H_2O_2: H_2O_2: H_2O_2: H_2O_2: H_2O_2: H_2O_2$) و MH₃: 1.5 می از هر آزمایش نمونه ها به مدت ۱۰ دقیقه در محلول HF ٪۰۰ (با C) می از هر آزمایش نمونه ها به مدت ۱۰ دقیقه در محلول HF ٪۰۰ (HF را C) می از می از

آزمایش ولتامتری چرخهای با سرعت روبش N۰۰ mV/s و بازه پتانسیل ۲۰ تا ۰/۶۷ انجام شد. برای اعمال پله پتانسیل در آزمایشهای کرونو آمپرومتری، ابتدا پتانسیل الکترود به مدت ۳ دقیقه در پتانسیلی که واکنشی در آن رخ نمی دهد نگه داشته شده و سپس به پتانسیل E_d تغییر داده می شد. پتانسیل E_d بین ۱۲۰ - تا TV۷ - انتخاب شد.

۳- نتایج و بحث شکل ۱ نمودار ولتامتری چرخه ای محلول پررنات را نشان میدهد همانطور که در شکل دیده می شود ترسیب رنیوم بر روی (Si(100) جدر پتانسیل حدود MV - آغاز شده و پتانسیل پیک در ۲۰۰ MV - مشاهده می شود. آزمایش های کرونو آمپرومتری به منظور بررسی مکانیزم رسوب الکتروشیمیایی رنیوم انجام شد. منحنی های جریان-زمان برای محدوده وسیعی از پتانسیلهای منفی از ۲۰۰ MV - تا ۲۰۰ MV - پس از حذف جریان خازنی در شکل ۲ نشان داده شده اند. برای بررسی ترسیب تحت شرایط پتانسیلهای اضافی (overpotential deposition)، پتانسیلهای منفی تر از پتانسیل تعادلی مورد توجه قرار گرفت.

ترسيب الكتروشيميايي رنيوم از...



شکل۱: ولتاموگرامهای رسم شده برای محلول پررنات ۰/۰۰۳M با۲= pH،سرعت روبش برابر است با۱۰۶ mV/s



شکل ۲- نمودار کرونو آمپرمتری از محلول M ۰۰۳ /۰ پررنات آمونیوم (pH =۲) ، پله پتانسیل اعمالی ۱) ۱۲۷۰- ۲). -۰/۱۸۷(۰- ، ۲) ۱۸۷(۰- ، ۲)/۱۶۷-

بررسی منحنی های کرونو آمپرومتری مطابق مدل جوانه زنی و رشد Palomar-Pardave [۷] برای جوانه زنی و رشد منحنی های کرونو آمپرومتری مطابق مدل جوانه زنی و رشد محا کردن جریان مربوط به احیاء رنیوم و احیاء رشد سه بعدی (تحت کنترل نفوذ) انجام شد که این مدل اجازه جدا کردن جریان مربوط به احیاء رنیوم و احیاء هیدروژن بر روی جوانه های رنیوم را میدهد که جریان مربوط به هر کدام مطابق معادلات زیر میباشد: $i_{H}(t) = P_{1} \times \left(1 - \exp\left\{-P_{2}\left[t - \frac{1 - \exp(-P_{3}t)}{P_{3}}\right]\right\}\right)$ (۳) ["]همایش ملی مواد نو "

$$i_{\text{Re}}(t) = (P_4 t^{-1/2}) \times \left(1 - \exp\left\{-P_2\left[t - \frac{1 - \exp(-P_3 t)}{P_3}\right]\right\}\right)$$
(F)

$$i_{\text{total}}(t) = i_H(t) + i_{\text{Re}}(t) = (P_1 + P_4 t^{-1/2}) \times \left(1 - \exp\left\{-P_2\left[t - \frac{1 - \exp(-P_3 t)}{P_3}\right]\right\}\right)$$
(A)

$$i_{\text{total}}(t) = i_H(t) + i_{\text{Re}}(t) = (P_1 + P_4 t^{-1/2}) \times \left(1 - \exp\left\{-P_2\left[t - \frac{1 - \exp(-P_3 t)}{P_3}\right]\right\}\right)$$
(A)

$$i_{\text{total}}(t) = i_H(t) + i_{\text{Re}}(t) = (P_1 + P_4 t^{-1/2}) \times \left(1 - \exp\left\{-P_2\left[t - \frac{1 - \exp(-P_3 t)}{P_3}\right]\right\}\right)$$
(A)

$$i_{\text{total}}(t) = i_H(t) + i_{\text{Re}}(t) = (P_1 + P_4 t^{-1/2}) \times \left(1 - \exp\left\{-P_2\left[t - \frac{1 - \exp(-P_3 t)}{P_3}\right]\right\}\right)$$
(A)

$$i_{\text{total}}(t) = i_H(t) + i_{\text{Re}}(t) = (P_1 + P_4 t^{-1/2}) \times \left(1 - \exp\left\{-P_2\left[t - \frac{1 - \exp(-P_3 t)}{P_3}\right]\right\}\right)$$
(A)

$$P_{1} = z_{H}Fk_{H}\left(\frac{2c_{o}M}{\pi\rho}\right)$$

$$P_{2} = N_{o}\pi kD$$

$$P_{3} = A$$

$$(\textbf{A})$$

$$P_4 = \frac{zFD^{1/2}c_o}{\pi^{1/2}}$$
(9)

N جرم مولی، ρ چگالی فلز ، D ضریب دیفوزیون و T جرم مولی، ρ چگالی فلز ، D ضریب دیفوزیون و T تعداد نقاط جوانه زنی می باشد[V] . با برونیابی معادله ۵ بر روی نمودارهای کرونو آمپرومتری, با استفاده از الگوریتم مار کوارت لونبر گ (Marquardt–Levenberg algorithm) پارامترهای p₁ تا p₄ بدست می آید که مقادیر بدست آمده در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول ۱ – مقادیر بدست آمده برای پارامترهای p_1 تا p_4 با استفاده از نمودارهای کرونو آمپرومتری در پتانسیلهای -1 – مقادیر بدست آمده برای پارامترهای -1 تا -1/1

-E(V)	$P_1 (mA cm^{-2})$	$P_2(s^{-1})$	$P_3(s^{-1})$	$P_4 (mA cm^{-2} s^{1/2})$	
•/14	•/114	•/184	• / ۳۵	1/44	
•/14	•/140	•/***	•/۴١	1/49	
•/18	•/174	• / ٣ ۶٧	•/44	١/۴۶	
•/1٨	•/**	•/844	•/۵	1/4	

لذا با توجه به مقادیر پارامترهای بدست آمده در جدول ۱ و رابطه ۴، نمودارهای جریان گذرا با حذف جریان مربوط به احیاء هیدروژن مجدداً رسم شد(شکل ۳). هر نمودار جریان گذرا دارای یک ماکزیمم مشخص بوده و قسمت صعودی قبل از آن نشان دهنده جوانه زنی و قسمت نزولی بعد از آن نشان دهنده کنترل رشد توسط نفوذ است. ترسیب الکتروشیمیایی رنیوم از... همانطور که در شکل ۳ دیده میشود منحنی های کرونو آمپرومتری به پتانسیل اضافی (overpotential) بستگی داشته و با افزایش پتانسیل اضافی، چگالی جریان افزایش و زمان لازم برای جوانه زنی کاهش مییابد. شکل منحنی ها نیز بوضوح نشان میدهد که سرعت جوانه زنی ورشد با نفوذ کنترل میشود.

با توجه به مقادیر جدول ۱ پارامترهای سینتیکی از جمله دانسیته جوانه ها بدست می آید. همانطور که در شکل ۴ مشاهده می شود با کاهش پتانسیل، دانسیته جوانه ها افزایش می یابد.

پارامتر بدون بعد α جهت تعیین مکانیزم ترسیب ترکیبات رنیوم بر روی الکترود سیلیکونی مطابق معادلات شاریفکر مورد استفاده قرار گرفت. مدل شاریفکر امکان تعیین معادلات جریان گذرا را در محدوده ای بین دو مکانیزم جوانه زنی، جوانه زنی ناگهانی یا همزمان (α کوچک) و جوانه زنی پیش رونده (α بزرگ) را میدهد[۸ – [۱۱].

پارامتر a مطابق معادله زیر تعریف میشود.

$$\alpha = \frac{P_2}{P_3} = \frac{N_0 \pi k D}{A} \tag{1.}$$

لذا با توجه به جدول ۱ و معادله ۱۰ پارامتر α محاسبه شد. نمودارهای بدون بعد α نسبت به پتانسیل از روی نمودارهای کرونو آمپرومتری رسم شدند و نتایج آزمایشگاهی با منحنیهای تئوری که از معادلات Scharifker بدست آمده اند به آسانی مقایسه شد.



شکل ۳- نمودار کرونو آمپرمتری برای رسوب رنیوم از محلولM ۰۰۳ /۰ پررنات آمونیوم (pH =۲) ، پله پتانسیل اعمالی ۱) ۱/۲۷ -۰ ۲/۱۴۷ (۰ -۰ ۲/۱۶ ۷(۲۰۰۰ ، ۴) ۰/۱۸۷ -۰ ۲/۱۵۷ (۰ -۰)

" مايش ملي مواد نو "



شکل ۴– نمودار دانسیته جوانه ها نسبت به پتانسیل اعمالی برای رسوب رنیوم از محلول M ۰۰۳ /۰ پررنات آمونیوم (pH =۲)

همانطور که در شکل ۵ دیده می شود با کاهش پتانسیل، α افزایش مییابد که این امر انتقال از حالت رشد لحظه ای به رشد پیشرونده را با کاهش پتانسیل نشان میدهد.



همچنین در شکل ۶ مورفولوژی رسوب توسط تصویر دستگاه AFM برای نمونه ترسیب شده در پتانسیل ۰/۱۶ و زمان ۱۰۰ ثانیه نشان داده شده است.

ترسيب الكتروشيميايي رنيوم از...



شکل ۶- تصویر AFM از کریستالهای رنیوم روی تک کریستال سیلیسیوم از محلول ۰/۰۰۳M پررنات آمونیوم با V /۱۶ V هط = -۰/۱۶

مراجع

1- V. Petrovich, M. Haurylau, S. Volchek, 'Rhenium deposition on a silicon surface at the room temperature for application in micro system', Sensors and Actuators, (2002), A 99, 45-48.

2. Eduardo Méndez, María F. Cerdá, Ana M. Castro Luna, Carlos F. Zinola, Carlos Kremer, and María E. Martins,' Electrochemical behavior of aqueous acid perrhenate-containing solutions on noble metals: critical review and new experimental evidence', Journal of Colloid and Interface Science 263,2003, 119–132

3- R. Schrebler, M. Merino, P. Cury, M. Romo, R. Córdova, H. Gómez, E.A. Dalchiele, "Electrodeposition of Cu_Re alloy thin films", Thin Solid Films 388,2001, 201-207.

4. G.A. Jones, C.A. Faunce, D. Ravinder, H.J. Blythe, V.M. Fedosyuk, "An investigation of the structural and magnetic properties of electrodeposited Co_xRe_{100-x} films", Journal of Magnetism and Magnetic Materials 184 (1998) 28-40.

5- R. Schreblera, T, P. Curya, C. Sua'reza, E. Mun'oza, F. Veraa, R. Co'rdovaa, H. Go'meza, J.R. Ramos-Barradob, D. Leinenb, E.A. Dalchielec, 'Study of the electrodeposition of rhenium thin films by electrochemical quartz microbalance and X-ray photoelectron spectroscopy', Thin Solid Films, 483, 2005 ,50–59

["]همایش ملی مواد نو "

6- J. Gomez, J.I. Gardiazabal and R. Cordova, "Electrochemical behaviour of rhenium in aqueous solutions", J. Electroanal. Chem 260 (1989) 113-126.

7- M. Palomar-Pardave', B.R. Scharifker, E.M. Arce, M. Romero- Romo, Electrochim. Acta. 50 (2005) 4736.

8- G. Gunawardena, G. Hills, T. Montenegro, B. Scharifker,' Electrochemical nucleation Part I. General considerations', J. Electroanal. Chem. 138 (1982) 255-239

9- Allen J. Bard, Larry R. Fulkner, "Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications", John Wiley & Sons Inc., New York, 1980.

10- B. Scharifker, G. Hills,' Theoretical and experimental studies of multiple nucleation', Electrochim. Acta 28 1983, 879-889

11- B.R. Scharifker, J. Mostany, J. Electroanal. Chem. 177 (1984) 13.

ترسيب الكتروشيميايي رنيوم از...

Rhenium Electrodeposition from Ammonium Perrhenate containing solution on silicon single crystal

H. Ataee Esfahani¹, S. K. Sadrnezhaad²,

Sharif University of Technology, Materials and Energy Research Center

ataee@mehr.sharif.edu, sadrnezh@sharif.edu

Abstract

Study was conducted on the morphology of rhenium electrodeposited on silicon single crystal. Silicon and Platinum plates were used as cathode and anode respectively. The pH of solution was adjusted to 2 by using H_2SO_4 and NH_4OH solutions. The conditions of perrhenate electroreduction and electrodeposition onto silicon electrode and the morphology of deposits were studied by cyclic voltammetry, chronoamperometry and AFM images studies. Nucleation and growth of Rhenium on the surface of P-Si (100) substrate were investigated in this research by means of chronoamperometry method and by utilization of atomic force microscopy. The results indicate a smooth transition to progressive nucleation with overpotential.

Keywords: Rhenium, Electrodeposition, Cyclic Voltammetry, Chronoamperometry, Silicon single crystal.

¹- graduate Student of Material Science and Engineering Department, Sharif University of Technology, Materials and Energy Research Center

²- Professor of Material Science and Engineering Department, Sharif University of Technology, Materials and Energy Research Center